

|특|허|정|보|

■자료제공 : 청우 국제특허법률사무소

원형 편광기 복합체 및 이를 포함하는 광학 시스템
(A CIRCULAR POLARIZER COMPOSITE AND AN OPTICAL SYSTEM COMPRISING THE SAME)

공개특허공보

공개번호 : 10-2007-0118765 (2007.12.18)
출원번호 : 10-2006-0052905 (2006.06.13)
출원인 : 쓰리엠 이노베이티브 프로퍼티즈 컴파니

요약

본 발명은 평면 편광기, 제1 1/4 파장 리타더, 콜레스테릭 액정(CLC) 필름 및 제2 1/4 파장 리타더를 포함하며, 제1 1/4 파장 리타더와 제2 1/4 파장 리타더의 광축이 수직으로 교차된 것인 원형 편광기 복합체에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 상기 원형 편광기 복합체 및 방출형 디스플레이 모듈을 포함하는 광학시스템을 제공한다.

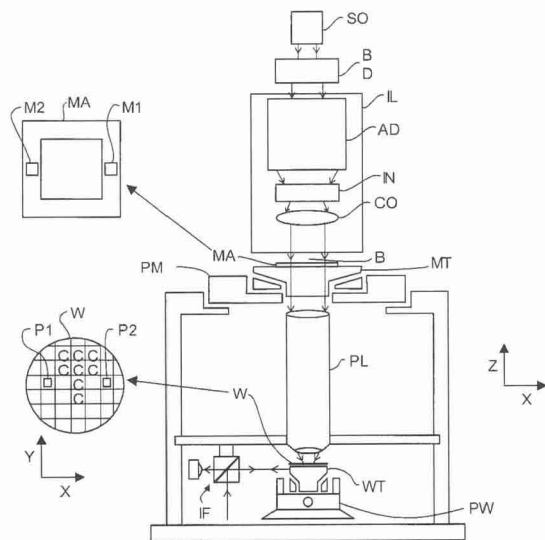
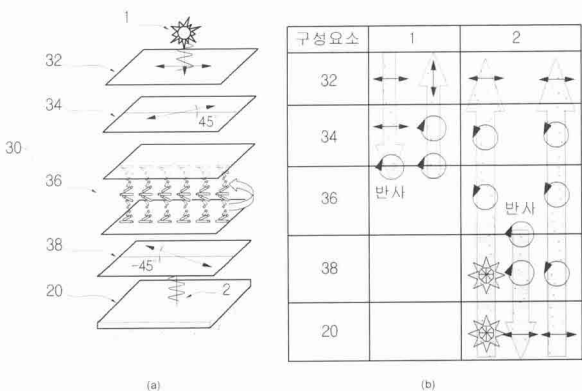
광학 시스템의 투과 손실의 특징화 방법
(A METHOD OF CHARACTERISING THE TRANSMISSION LOSSES OF AN OPTICAL SYSTEM)

공개특허공보

공개번호 : 10-2007-0118967 (2007.12.18)
출원번호 : 10-2007-0057156 (2007.06.12)
출원인 : 에이에스엠엘 네델란즈 비.브이.

요약

CCD 검출기를 사용하여 방사선 빔의 조명 프로파일이 먼저 측정된다. 이어서 기준 거울이 고도 어퍼처 렌즈의 초점 평면에 위치되고 반사된 방사선이 측정된다. 조명 프로파일 및 검출된 방사선을 비교함으로써 이후에 스캐터로메트리 모델링에 사용될 수 있는 S 편광 및 P 편광에 대한 투과 손실들을 결정할 수 있다.



광 편향기 및 이를 이용한 광학기구
(OPTICAL DEFLECTOR AND OPTICAL INSTRUMENT USING THE SAME)

공개특허공보

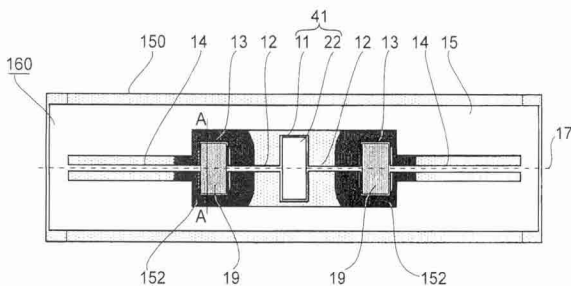
공개번호 : 10-2007-0115680 (2007.12.06)

출원번호 : 10-2007-0052010 (2007.05.29)

출원인 : 캐논 가부시끼가이샤

요약

본 발명의 광 편향기는 진동 시스템 및 상기 진동 시스템을 구동하도록 구성된 구동 시스템을 포함한다. 진동 시스템은 제1 진동자와 제1 비틀림 스프링과 제2 진동자와 제2 비틀림 스프링과 지지 부재를 포함하고, 제1 진동자는 광을 편향시키도록 구성된 편광소자를 갖는 제1 가동소자를 포함하고, 제2 진동자는 질량을 조절하도록 구성된 질량 조절부재를 갖는 제2 가동소자를 포함하고, 제1 가동소자는 진동축을 중심으로 한 비틀림 진동을 위해 제1 비틀림 스프링을 통해 제2 가동소자에 의해 탄성 지지되고, 제2 가동소자는 진동축을 중심으로 한 비틀림 진동을 위해 제2 비틀림 스프링을 통해 상기 지지부재에 의해 탄성 지지되며, 진동 시스템은 진동축을 중심으로 주파수가 서로 다른 적어도 두 개의 고유 진동모드를 갖는다.



다 매질에서 측정 가능한 광학계를 이용한 표면 플라즈몬 공명 장치
(SURFACE PLASMON RESONANCE MEASUREMENTS USING MODIFIED OPTICS FOR MULTI-MEDIA)

공개특허공보

공개번호 : 10-2007-0114440 (2007.12.04)

출원번호 : 10-2006-0047972 (2006.05.29)

출원인 : 재단법인 서울대학교 산학협력재단

요약

본 발명은 표면 플라즈몬 공명 현상(SPR : Surface Plasmon Resonance)을 측정하는 장치에 관한 것으로, 레이저 광이 발생하는 레이저 모듈; 상기 레이저 모듈에서 발생하는 레이저 광을 확산-수렴시키는 광학계; 상기 광학계를 통과한 레이저 광이 입사되는 광학 프리즘; 분석하고자 하는 시료가 놓여지는 반응셀(cell); 및 상기 광학 프리즘으로부터의 반사광을 측정하는 광 센서가 배열된 광센서 어레이 모듈이 구비된 표면 플라즈몬 공명장치를 제공한다. 본 발명은 매질의 종류에 따라 프리즘을 교체하거나 또는 입사각을 조절하기 위해 광학 장치를 회전시키는 등의 기계적인 조작 과정이 불필요하기 때문에, 표면 플라즈몬 공명 현상의 분석 효율을 크게 향상시킬 수 있다. 본 발명은 매질의 종류에 구애됨 없이 SPR 현상을 용이하게 측정할 수 있는 다(多) 매질용 측정 장치로서, 입사각을 조절하기 위해 광학 장치를 회전시킴에 따라 분석 시간이 지연되는 문제가 없고, 분석 장치의 얼라인(aline)에 따른 번거로움과, 얼라인에 따른 실험 오차의 우려가 없다는 장점이 있다.

